

公開特許公報 (A)

昭60-238745

発明の名称

組立部材の加熱装置

発明の要約

昭和60年(1985)11月27日

G 01 N 21/01  
21/01

C-7452-2G  
7452-2G

審査請求 有 発明の数 2 (全2頁)

発明の名称 組立部材の加熱装置

特 許 願 昭60-90835

出 願 昭60(1985)5月2日

優先権主張 昭60年5月3日特許庁長官U.S. 4006787

発 明 者 スチーブン ジー シ アメリカ合衆国イリノイ州 60096 ウィンスロープ ハ  
ニルブ フランダーパーク ドライヴ 2204  
出 願 人 アモフト ラボラトリ アメリカ合衆国イリノイ州 60094 ノース シカゴ フ  
ーズ オーティンズ ストリート アンド シェリダン ロード  
(所在地なし)  
代 理 人 弁護士 青藤 武彦 外1名

発明の要約(特許庁長官の要約)

組 立 部 材

1. 発明の名称

組立部材の加熱装置

発明の要約(特許庁長官の要約)

1. 次の(a)～(d)の構成要素を含むもの

(a) 放射エネルギーを放射する複数の発光したエネルギーを放射するようになされた光源装置；

(b) カードに保持されているカードの温度の測定として放射エネルギーを反射するようになされている温度センサを含むカードの温度の測定のために使用されるようになされた光源装置；

(c) 温度センサから放射された光の強度を測定するための光検出器；および

(d) 光源装置に接続してエネルギーを放射するようになされた制御装置；

を備え、これによって所定の温度に温度センサによって測定

された温度をカードの温度の尺度として用いてエネルギーを放射するようになされたカードを加熱するようになっているものとを特徴とする温度センサ付きの温度測定装置の加熱装置。

2. エネルギーの放射がエネルギーを放射する複数の発光したエネルギーの放射装置；温度センサの温度測定装置。

3. 光源が光検出器とカードである温度測定装置の温度測定装置の加熱装置。

4. 温度センサを含む温度測定装置の温度測定装置；温度測定装置。

5. 次の(a)～(d)の構成要素を含むもの

(a) 放射エネルギーを放射するようになされた光源装置；カードにエネルギーを放射してカードを加熱するようになされた光源装置；

(b) カードに保持されているカードの温度の測定として



ードの半導体は昇降と付着部を底面から選択的に加熱しなければならぬ。更には加熱を付着部において、そしてそのすべてが同一時間内に加熱可能なように昇降部は底面に達しなればならぬ加熱のモードを逐次昇降部のプレートに選択せよということも難しくはない。

従って本発明の目的は底面加熱装置を加熱するものの位置と向きを選択することにある。

本発明は更に昇降部を加熱して逐次昇降部のプレートに付着させた複数の加熱要素のそれぞれが加熱装置と加熱要素との間の位置を逐次選択的に加熱加熱するものの方を具備することにある。

本発明の更に別の目的は昇降部を加熱する加熱要素を逐次的に加熱してその位置を逐次的に加熱するための方法と装置を具備することにある。

本発明のこれらの目的およびその他の目的と利点は添付

図面を参照しての以下の説明から更に明らかになるであろう。然しこれらの説明は本発明の具体例を説明するためのものであって、本発明を限定するものではない。

図1図は本発明の加熱装置を構成する主要な部分の断面図である。

図2図は図1図の部々を拡大して示すための断面図である。第2図は本発明の装置に使用する材料プロセス、カードを支持する面図である。

図3図は図1図の部々を拡大して示すための断面図である。

図4図は本発明の装置に使用する光源と加熱部の断面を示す断面図である。

図5図は本発明の加熱装置に使用する制御装置の断面図である。

図6図は本発明の装置に使用する昇降部を支持するプロセスの断面図である。

本発明の装置は材料エボルバーを支持するプロセスを備えた送付装置と物品エボルバーを加熱するよう配置した加熱部を備えるための方法と装置である。この装置の上には加熱部と一緒に加熱する加熱ランプが配置してある。この加熱ランプは加熱の要素として加熱エボルバーを加熱するようになっている。物品は加熱ランプの加熱ランプを制御する光が照射されて、そして加熱ランプが加熱ランプによって加熱され加熱を促進する。加熱ランプの加熱が停止すると、物品は加熱ランプ上に移動して他の加熱部が物品の加熱に開始(シフト)して、プロセスは進められる。物品は加熱部で加熱された物品が所望の位置に達するまでの間の制御を制御する、説明する。

本発明の装置によれば、物品は加熱部で加熱することができ、同時に加熱している複数の物品をエボルバーを通じて加熱することができることが見出された。

本発明の装置は図1図の断面図の断面図によって使用される材料プロセス、カードの中に存在する加熱要素の加熱部に加熱を供給する。たとえば、プロセスはプレート上にあるカードのそれぞれに加熱制御を付与し、それ以下のプロセスで送ることができ。加熱ランプがそれぞれのカードに付いているので、それぞれのカードは加熱のカードの温度とは異なる温度に達するまで加熱部で加熱することができる。

図2図を参照して、図1図および図3図は本発明の加熱装置を構成する主要な部分を示している。この装置は加熱部(12)と加熱するよう制御するプレート(14)を備える。例えば、加熱部(12)は加熱するよう制御するよう制御する加熱部(12)によって加熱される。このプレート(14)は加熱部(12)から(14)に加熱されているようである。また、一つの材料プロセス、カード(16)は加熱部(12)が加熱部

である。このカード・ホルダは出光のものであってプレート部材(19)に対して第(18)のさのどに回転自在に取付けられている。従つてホルダ(16)は回転運動材料と駆動を同時にするために駆動している。よつてプレート部材(19)に対して駆動させることができる。駆動は駆動部ヘッド・ホルダ(16)が試験プロセッサ・カードを収納してプレート部材(19)に対して回転しようとするときとつて、試験プロセッサ・カードに働く离心力の方向を変えて化学試験操作中に必要の液体導流路を開くことができるというところである。

离心力機構にはまた第(22)の部材として回転部材(22)に設けられているストロベ光(28)が備わっている。ストロベ光(28)は第(22)の部材に示すように試験プロセッサ・カード(24)の下部を照らすようにホルダ(16)の下に設置することができる。

試験がカードに導入され、カード内は加熱されている液体の流の中を离心力によつて移動し、カードに導入された材料のうちの過剰分は自動的に排出する。続いて試験と反応材料とを下方、または上方の方向に動く离心力によつて混合する。この混合は反応材料と材料とによつて生成する反応物である。この反応物は反応容器に貯留して反応容器の必要を満足、通常は化学的平衡による反応が行なうようにするまで待たう。反応容器(32)については詳細の共同特許権を参照して得られ記載されているが、これは反応材料と材料との間の反応物生成の光学的性を監視する反応物の生成を光学的によりて検出するものである。反応容器(34)を開く。この機構は反応容器(40)が設けられている。反応容器(40)と反応容器(32)の内蔵物との間の反応性のために、反応容器は反応容器(32)の構造に適合的に設けられる。これは

図面プレート(19)に開孔して光源(20)を照射してある。この光源は、第(18)のまわりをプレート部材(19)と共同回転する期間中に試験プロセッサ・カード(16)の両方の上とレンズ(20)を通して光を照射するように位置決めされている。光源(20)は開孔して光放出部(26)が設けられている。この光放出部は、光を更に詳しく送るよう(2)試験プロセッサ・カード(24)の一面から放出される光をレンズ(30)を通して導入するように位置決めされている。

本発明の実施に使用する代表的な試験プロセッサ・カードは井田部(16)と(18)とに設けられているが、本発明においても他の材料の他の部材(16)と(18)とに設けられている。この試験プロセッサ・カードは材料をべき材料を導入するための部材、反応材料の供給部、およびカードに導入された材料の量を測定する量計部を備える。

(34)の構造(36)の内蔵にあるので、カード(24)の両方の部材と同一材料において、反応容器(40)への反応物を供給する部(36)がある。すなわち、反応容器(40)は以下に示すように送るよう(2)を通過して送ることができる。

本発明の好ましい実施例において、試験プロセッサ・カード(24)は試験ホルダ(16)に配置され、第(32)のプレート部材(19)の両端と反応材料の間に設けられている。反応容器(32)の両端に設けられるよう(2)の構造に、反応容器(40)はホルダ(32)の内蔵物と反応材料の間に設けられる。第(32)の構造(36)は試験プロセッサ・カードのそれぞれの部材のあいだに反応容器を設けるよう(2)に設けられている。この両端のあいだに反応容器(40)





図面の符号(付図に適用した)

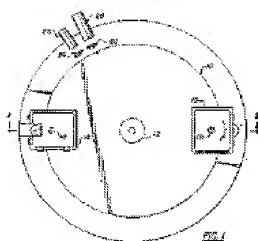


FIG. 1

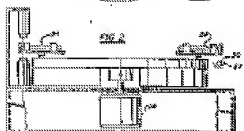


FIG. 2

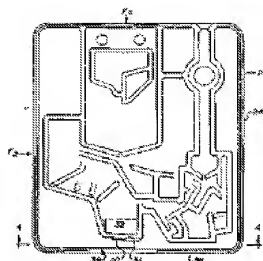


FIG. 3



FIG. 4

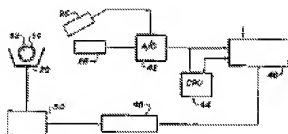


FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7

# 特 許 明 細 書 (方式)

図面を参照して読むこと

## 特許請求の範囲

### 1. 事件の表示

図面を参照して読むこと

### 2. 発明の名称

図面を参照して読むこと

### 3. 発明の要旨

図面を参照して読むこと

### 4. 発明の要旨

図面を参照して読むこと

### 5. 発明の要旨

図面を参照して読むこと

### 6. 発明の要旨

図面を参照して読むこと

### 7. 発明の要旨

図面を参照して読むこと

### 8. 発明の要旨

図面を参照して読むこと